

УМС®-ТМИ-02/5000

Тестер механических испытаний УМС-ТМИ-02/5000 для полуавтоматического контроля на сдвиг полупроводниковых кристаллов и полупроводниковых элементов после монтажа на носитель (плату).



Назначение:

Тестер механических испытаний УМС-ТМИ-02/5000 предназначен для контроля на сдвиг после монтажа полупроводниковых кристаллов и полупроводниковых элементов на носитель (плату) методом эвтектической пайки или методом монтажа кристалла на клей.

Технические характеристики:

- Два режима работы:
 - неразрушающий контроль до заданного значения;
 - разрушающий до максимально возможного.
- Ход инструмента контроля («лопаточка») по оси Y не менее 15 мм.
- Ход инструмента контроля («лопаточка») по оси Z не менее 25 мм.
- Диапазон измерения усилия нагружения для проволочных перемычек 0 – 5000 сН.
- Максимальная абсолютная погрешность измерения усилия нагружения ± 30 сН.
- Габаритные размеры установки (470x450x400) мм.
- Масса установки не более 30 кг.
- Размер рабочего поля пантографа (для точного перемещения) не менее 15x15 мм.
- Обрабатываемое поле прибора (грубое перемещение) 48x60 мм.

Образцы тестируемых приборов

